

SYLABUS

DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2020-2022

(skrajne daty)

Rok akademicki 2021/2022

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu	Nanolitografia – do wyboru
Kod przedmiotu*	
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek	Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nazwa jednostki realizującej przedmiot	Kolegium Nauk Przyrodniczych
Kierunek studiów	Inżynieria materiałowa
Poziom studiów	studia drugiego stopnia
Profil	ogólnoakademicki
Forma studiów	stacjonarne
Rok i semestr/y studiów	II rok, 2 semestr
Rodzaj przedmiotu	specjalnościowy do wyboru
Język wykładowy	polski
Koordinator	dr Dariusz Płoch
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących	dr Dariusz Płoch

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr (nr)	Wykł.	Ćw.	Konw.	Lab.	Sem.	ZP	Prakt.	Inne (jakie?)	Liczba pkt. ECTS
2	15			30					4

1.2. Sposób realizacji zajęć

☒ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku)

Wykład – egzamin

Laboratorium – zaliczenie z oceną

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość podstaw fizyki klasycznej, analizy matematycznej i algebry liniowej, konieczność zaliczenia przedmiotu Fizyka ciała stałego.

3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu

C1	Zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami litograficznymi stosowanymi do wytwarzania struktur niskowymiarowych oraz sub-mikronowych elementów urządzeń nanoelektronicznych,
C2	Zapoznanie studentów ze sposobami modelowania komputerowego efektów związanych z ekspozycją i wywoływaniem foto- i elektrono-rezystów, przy wykorzystaniu pakietu Octave/Matlab.
C3	zrozumienie podstaw fizycznych i chemicznych efektów wykorzystywanych w procesach litograficznych, takich jak procesy adhezji i zwilżania, oddziaływania fotonów, elektronów i jonów z materiałem rezystu i podłoża, ma zapoznać z różnorodnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w celu przeniesienia projektu (wzoru) na materiał substratu i czynnikami wpływającymi na uzyskaną zdolność rozdzielczą.
C4	wykształcenie umiejętności optymalnego projektowania elementów nanoelektronicznych oraz właściwy wybór odpowiedniej metody litograficznej dzięki znajomości mocnych stron i ograniczeń danej metody.

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

EK (efekt uczenia się)	Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu	Odniesienie do efektów kierunkowych
EK_01	Student ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania termodynamiki do opisu i modelowania procesów obróbki cieplnej, przemian fazowych, dyfuzji atomów w procesach technologicznych; Student ma elementarną wiedzę o cyklu życia produktów oraz na temat zasad funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii wytwarzania materiałów, szczególnie w aspekcie wytwarzania nanomateriałów mających zastosowanie w przemyśle lotniczym; Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały do projektowania, modelowania, symulacji i wytwarzania elementów i urządzeń technicznych oraz rozwiązywania za ich pomocą prostych zagadnień technicznych i badawczych	K_Wo2 K_Wo3 K_Wo7
EK_02	Student potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zbudować proste urządzenie, obiekt, system lub proces typowe dla inżynierii materiałowej używając właściwych technik metod i narzędzi;	K_Uo3 K_Uo5 K_Uo6 K_Uo8 K_U10

	Student potrafi zaprojektować proces litograficzny zgodnie z zadaną specyfikacją, ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi	K_U11
EK_03	Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, potrafi pracować w grupie, docenia zasady etyki zawodowej, myśli kreatywnie.	K_Ko1 K_Ko3 K_Ko4

3.3 Treści programowe

A. Problematyka wykładu

Treści merytoryczne: Podstawowe procesy litograficzne: Litografia jako proces przeniesienia wzoru (projektu) na materiał substratu, czyszczenie podłoża i adhezja, typy rezystów i ich nakładanie, dopasowywanie (alignment) i ekspozycja wzoru, wywoływanie, pomiary i inspekcja wyników, post-processing.
Fotolitografia: fotorezysty, modelowanie procesów fotochemicznych, efekty optyczne, aberracja światła, metody ekspozycji (kontaktowa, zbliżeniowa i projekcyjna), konstrukcja urządzeń do ekspozycji zbliżeniowej (stepper), maski fotolitograficzne, ich wytwarzanie, fotolitografia immersyjna, fotolitografia dalekiego ultrafioletu (EUV), zdolność rozdzielcza, koszty.
Elektronolitografia: rezysty elektrono-czułe, oddziaływanie wiązki elektronów z materią, procesy ekspozycji, konstrukcje kolumny elektronowej, wywoływanie i profil uzyskanej maski, rezysty wielowarstwowe, parametry ekspozycji, problem tzw. poprawek bliskości (proximity effects), konstrukcja urządzeń do elektronolitografii, litografia 3-wymiarowa (3D), zdolność rozdzielcza koszty.
Metody alternatywne: litografia jonowa (FIB), wykorzystanie mikroskopów z sondą skanującą (STM i AFM), fotolitografia laserowa, litografia mechaniczna wykorzystująca nanodruk (nanoimprint lithography).
Zastosowania: przykłady nanostruktur uzyskanych za pomocą różnych metod litograficznych, porównanie parametrów : zdolności rozdzielczej i szybkości działania, wpływ zastosowanej metody na modyfikację parametrów podłoża, metody obróbki po procesie litograficzny (post processing): trawienie, metalizacja.

B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych

Treści merytoryczne: Projektowanie nanosturktur. Wykonanie pełnego projektu elektrono-litograficznego nanotranzystora, przy wykorzystaniu programu Nanomaker (typu CAD), projekt powinien zawierać wszystkie funkcjonalne elementy takie jak kontakty elektryczne, linie separujące, bramki elektrostatyczne oraz znaczniki (markery) umożliwiające właściwe dopasowanie (alignment) kolejnych poziomów projektowych, rozmiary wykonywanych elementów powinny zawierać się w przedziale od 1mm do 100 nm.
--

Modelowanie ekspozycji: Obliczenia właściwych parametrów ekspozycji w litografii elektronowej, przy uwzględnieniu tzw. poprawek bliskości (proximity corrections). Zadaniem ćwiczenia jest implementacja algorytmu dla poprawek bliskości, opartego na szybkiej transformacie Fouriera oraz transfer danych do formatu rozpoznawalnego przez systemy litograficzne.

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, praca w grupach.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu	Metody oceny efektów uczenia się (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)	Forma zajęć dydaktycznych (w, ćw, ...)
EK_01	Egzamin, kolokwium, prace pisemne, obserwacja w trakcie zajęć	W, Lab.
EK_02	Egzamin, kolokwium, prace pisemne, obserwacja w trakcie zajęć	W, Lab.
EK_03	Obserwacja w trakcie zajęć	Lab.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Zaliczenie przedmiotu potwierdzi stopień osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się kontrolowana jest na bieżąco w trakcie przeprowadzenia zajęć. Końcowa ocena będzie odzwierciedleniem stopnia osiągniętych efektów. Weryfikacja efektów uczenia się z wiedzy i umiejętności przekazanej przez nauczyciela odbywać się będzie przez egzamin, kolokwium, prace pisemne, udział w dyskusji. Sprawdzenie efektów dla zajęć bez udziału nauczyciela odbywać się będzie poprzez ocenę przygotowania studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin, prace pisemne, aktywność w trakcie zajęć i podczas dyskusji. Weryfikacja kompetencji społecznych odbywać się będzie poprzez aktywność na zajęciach i udział w dyskusji.

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z laboratorium.

Laboratorium: zaliczenie z oceną

Warunkiem zaliczenia jest: uzyskanie oceny z wiedzy i przygotowania merytorycznego do ćwiczeń, zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią z ocen częściowych.

Stosowana skala oceniania:

dst. (51-60)% pkt.

+dst (61-70)% pkt.

db (71-80)% pkt.

+db (81-90)% pkt. bdb (91-100)% pkt.

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów	45
Inne z udziałem nauczyciela akademickiego (udział w konsultacjach, egzaminie)	5
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)	50
SUMA GODZIN	100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	4

** Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy	Nie dotyczy
zasady i formy odbywania praktyk	Nie dotyczy

7. LITERATURA

Literatura podstawowa:
1. H. J Levinson, Principles of Lithography SPIE Press Monograph, 2011 – udostępnia prowadzący
2. Mohammad Ali Mohammad, Mustafa Muhammad, Steven K. Dew, and Maria Stepanova, Fundamentals of Electron Beam Exposure and Development, www.springer.com/.../9783709104231-c1.pdf .
Literatura uzupełniająca:

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej